

仪器名称	测试项目
Quanta400FEG 热场扫描电镜	微观形貌
	能谱元素分析
	常温阴极荧光/电子束诱导感生电流
S-4800 冷场扫描电镜	微观形貌
Quanta250FEG 场发射环境扫描电镜	微观形貌
	能谱元素分析
	环境扫描或低真空模式
TF20 透射电镜	TEM 测试
	能谱测试
	STEM 测试
HT7700 透射电镜	形貌像
	能谱
Talos 透射电镜	TEM
	STEM
	能谱 Mapping
透射电镜制样	TEM 截面样品:
	切割、抛磨、减薄设备使用费
溅射镀膜仪	喷金
	喷铂或喷碳
Ilion 制样	Ilion 制样
Agilent G200 纳米压痕仪	压入((硬度 \leq 20GPa)
	压入((硬度 $>$ 20GPa)
	划痕((硬度 \leq 20GPa)
	划痕((硬度 $>$ 20GPa)
	原位扫描成像模式 (Nanovision)
	MEMS 力学测试
原子力显微镜	表面形貌
	EFM, KFM, MFM
	SCM, CAFM, SSRM
	纳米刻蚀
	HarmoniX
	液体环境/气氛
	STM
纳米粒度仪和 Zeta 粒度仪	粒度测试

仪器名称		测试项目
半导体特性分析系统		直流、脉冲 IV 测试和 CV 测试
变温 Hall 测试系统 (4K~300K)		载流子浓度、迁移率、方块电阻等测试
Agilent E5071C 网络分析仪 (100kHz~4.5GHz)		传输特性和反射特性
Stanford SR770 网络分析仪 (mHz~100kHz)		噪声谱分析
LED 综合光电测量系统		LED 性能参数, 光通量、色温、光效等
红外探测器测试系统		黑体响应度等测试
太阳能电池综合性能测试		IV、聚光 IV、EQE
变温测试系统	光致发光光谱	325 He-Cd 激光器 其余激光器
	傅里叶变换红外光谱仪	常温
		低温
	变温电学测试系统	
拉曼光谱仪		微区拉曼及 PL 测量
M-2000DI 光谱型椭圆偏振测量仪		薄膜厚度、光学常数、等
Nikon A1 激光共聚焦显微镜		细胞、组织观测, 图像 3D 立体重构等
高分辨 X 射线衍射仪		双晶、三轴晶摇摆曲线, $\omega/2\theta$ 扫描
		镜面反射测量
		面内小角衍射 (IPGID)
		倒空间 mapping, 极图
		高温测试 (<1000°C)
粉末 x 射线衍射		物相分析
cluster 微机集群		普通计算